

## График загрузки оборудования ЦКП «Высокие технологии» ЮФУ

Оборудование	Планируемая/фактическая загрузка оборудования ЦКП на март 2019 года																															Итого	% исп.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Сканирующий зондовый микроскоп Solver Pro-M (HT-МДТ)				4	4	4					4	4	4					6	6	6						6	6							54	33,75
Дериватограф Diamond TG/DTA (PerkinElmer)				6	6	6	6				6	6	6	6				6	6	6	6					6	6							84	52,5
Специализированный комплекс получения микро и нанопорошков сегнето- и пьезоматериалов, формирования, синтеза, обжига и измерения параметров исследуемых образцов Пьезо-1				8	8	8	8				8	8	8	8	8				8	8	8	8	8				8	8	8	8				144	90
Электрокамерная печь Nabertherm HT16/16				8	8						8	8	8					8	8	8						8	8	8	8					96	60
Лабораторная циркуляционная диспергирующая установка ЛЦДУ-3/0,0005-ОК-МНД				8	8	8	8				8	8	8	8																				64	40
Комплекс оборудования для литья керамической ленты Кеко				8	8	8	8				8	8	8	8					8	8	8	8					8	8	8	8				128	80
Комплекс оборудования (для изготовления электронных компонентов LTCC (КЕКО Equipment))				8	8	8	8				8	8	8	8					8	8	8	8					8	8	8	8				128	80
Специализированный комплекс Кеко Equipment для получения и исследования свойств элементной базы композиционных и керамических сегнетоматериалов				8	8	8	8				8	8	8	8					8	8	8	8					8	8	8	8				128	80



Газовый хромато-масс-спектрометр GCM-QP2010SE (Shimadzu)				8	8	8	8					8	8	8	8					8	8	8	8					128	80
He-Cd лазер IK3501 R-G (Kimmon) в комплекте с блоком питания и измерителем мощности и энергии ES245C PM100D				8	8	8	8					8	8	8	8					8	8	8	8					128	80
ВСЕГО																													
	- оборудование доступно к использованию																												
	- оборудование занято частично (часов в день)																												
	- оборудование занято полный рабочий день (8 часов)																												
	- оборудование занято круглосуточно (24 часа)																												